【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【公表番号】特表2017-503664(P2017-503664A)
【公表日】平成29年2月2日(2017.2.2)
【年通号数】公開・登録公報2017-005
【出願番号】特願2016-541278(P2016-541278)
【国際特許分類】
Ｂ２３Ｑ　7/10　(2006.01)
Ｂ２４Ｄ　3/00　(2006.01)
Ｂ６５Ｇ　47/53　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｂ２３Ｑ　7/10
Ｂ２４Ｄ　3/00　３４０
Ｂ６５Ｇ　47/53　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年12月11日(2017.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
本発明の範囲内の他の実施形態が、添付の項目から明らかとなろう。以下、本発明の実施形態の例を列記する。
〔１〕
第１位置と第２位置の間で複数の個別物品を移動するための移動装置であって、前記移動装置は：
少なくとも１つの物品受容手段を備え、前記第１位置に隣接して配置されて少なくとも１つの物品を受容し、かつ前記第２位置に隣接して配置されて前記少なくとも１つの物品を送り出すように構成されている、移動ビームと；
前記第２位置に隣接し、かつ、前記移動ビームが第１ブリッジコンベアと第２ブリッジコンベアとの間に移動可能なように離間して配置されている、第１及び第２ブリッジコンベアと、
を含む、移動装置。
〔２〕
前記移動ビームが、複数の受容手段を備える、項目１に記載の装置。
〔３〕
前記移動ビームが、規則的間隔で配置された物品受容手段の配列を備える、項目１又は２に記載の装置。
〔４〕
前記配列が、直線的に配置された受容手段である、項目３に記載の装置。
〔５〕
前記受容手段が位置決め器を含む、項目１～４のいずれか一項に記載の装置。
〔６〕
前記位置決め器が円柱ポストを含む、項目１～５のいずれか一項に記載の装置。
〔７〕
前記物品が研磨物品である、項目１～６のいずれか一項に記載の装置。

〔８〕
前記物品が研磨ディスクである、項目１～７のいずれか一項に記載の装置。
〔９〕
第１位置と第２位置の間で複数の個別物品を移動するための方法であって、前記方法は：
複数の個別物品を前記第１位置に送達する工程と；
少なくとも１つの物品受容手段を備える移動ビームを、前記第１位置に隣接して配置する工程と；
前記少なくとも１つの物品を前記受容手段上に受容する工程と；
前記移動ビームを前記第２位置に隣接して配置する工程と；
前記第２位置に隣接し、かつ、前記移動ビームが第１ブリッジコンベアと第２ブリッジコンベアとの間に移動可能なように離間して配置されている前記第１ブリッジコンベアと前記第２ブリッジコンベアとの間に、前記移動ビームを動かす工程と；
前記少なくとも１つの物品を、前記物品受容手段から、前記第１及び第２ブリッジコンベア上へと送り出す工程と、
を含む、移動方法。
〔１０〕
前記少なくとも１つの物品を送り出す工程は、前記少なくとも１つの物品が前記第１及び第２ブリッジコンベア上に残るように、前記移動ビームを前記第１及び第２ブリッジコンベアに対して低くする工程を含む、項目９に記載の方法。
〔１１〕
前記少なくとも１つの物品を送り出した後に、前記移動ビームを前記第１位置に隣接するように戻す工程を更に含む、項目９又は１０に記載の方法。
〔１２〕
前記複数の個別物品が、コンベア上で前記第１位置に送達される、項目９～１１のいずれか一項に記載の方法。
〔１３〕
前記方法は：
前記コンベアから前記少なくとも１つの物品を取り上げる工程と；
前記少なくとも１つの物品を、前記受容手段に隣接するよう動かす工程と；
前記少なくとも１つの物品を、前記受容手段上に落とす工程と、
を更に含む、項目１２に記載の方法。
〔１４〕
前記移動ビームが、規則的間隔で配置された物品受容手段の配列を含む、項目９～１３のいずれか一項に記載の方法。
〔１５〕
前記配列が、直線的に配置された受容手段である、項目１４に記載の方法。
〔１６〕
前記受容手段が円柱ポストを含む、項目９～１５のいずれか一項に記載の方法。
〔１７〕
前記物品が研磨物品である、項目９～１６のいずれか一項に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１位置と第２位置の間で複数の個別物品を移動するための移動装置であって、前記移動装置は：

少なくとも１つの物品受容手段を備え、前記第１位置に隣接して配置されて少なくとも１つの物品を受容し、かつ前記第２位置に隣接して配置されて前記少なくとも１つの物品を送り出すように構成されている、移動ビームと；
前記第２位置に隣接し、かつ、前記移動ビームが第１ブリッジコンベアと第２ブリッジコンベアとの間に移動可能なように離間して配置されている、第１及び第２ブリッジコンベアと、
を含む、移動装置。
【請求項２】
前記位置決め器が円柱ポストを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記物品が研磨物品である、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
前記物品が研磨ディスクである、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
第１位置と第２位置の間で複数の個別物品を移動するための方法であって、前記方法は：
複数の個別物品を前記第１位置に送達する工程と；
少なくとも１つの物品受容手段を備える移動ビームを、前記第１位置に隣接して配置する工程と；
前記少なくとも１つの物品を前記受容手段上に受容する工程と；
前記移動ビームを前記第２位置に隣接して配置する工程と；
前記第２位置に隣接し、かつ、前記移動ビームが第１ブリッジコンベアと第２ブリッジコンベアとの間に移動可能なように離間して配置されている前記第１ブリッジコンベアと前記第２ブリッジコンベアとの間に、前記移動ビームを動かす工程と；
前記少なくとも１つの物品を、前記物品受容手段から、前記第１及び第２ブリッジコンベア上へと送り出す工程と、
を含む、移動方法。
【請求項６】
前記複数の個別物品が、コンベア上で前記第１位置に送達される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記方法は：
前記コンベアから前記少なくとも１つの物品を取り上げる工程と；
前記少なくとも１つの物品を、前記受容手段に隣接するよう動かす工程と；
前記少なくとも１つの物品を、前記受容手段上に落とす工程と、
を更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記受容手段が円柱ポストを含む、請求項５～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
前記物品が研磨物品である、請求項５～８のいずれか一項に記載の方法。